



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE GRABADO SECO PARA NANOESTRUCTURAS Y CAPAS DELGADAS DE SILICIO Y DERIVADOS DE SILICIO DESTINADO AL INSTITUTO DE MICROELECTRÓNICA DE BARCELONA, IMB-CNM, DE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, M.P.

PROYECTO FEDER REF. FICTS2019-02-40 "MINATEC PLUS2: Consolidación y evolución de las infraestructuras para las Micro y Nanotecnologías de la Sala Blanca del CSIC que den respuesta a los nuevos retos sociales y a la innovación industrial"

El objetivo de este contrato es la adquisición de un Sistema de Grabado Seco (R.I.E) para la micro y nano fabricación de componentes y circuitos electrónicos NO-CMOS.

Por los motivos siguientes: Este sistema RIE de grabado seco por plasma supondrá disponer de un equipamiento clave para el desarrollo de procesos de nanofabricación. Permitirá transferir patrones nanométricos sobre una gran diversidad de sustratos para la fabricación de dispositivos en una gran variedad de campos de aplicación, como la fotónica, biosensores y materiales 2D.

El equipo pretende cumplir con las necesidades de grabado de silicio y sus derivados en la línea de fabricación NO-CMOS y debe permitir transferir patrones nanométricos sobre una gran diversidad de sustratos para la fabricación de dispositivos 2D para obleas o muestras de hasta 150 mm de diámetro sin la necesidad de intervenir en la configuración del equipo inicial. La adaptación a los distintos tamaños de muestras debe ser rápida y con resultados de proceso comparables tanto para obleas de 150 mm como de 100 mm o menores.

Es un equipo que, desde su emplazamiento en la Sala Blanca del IMB-CNM, será gestionado por el personal de apoyo a la investigación dedicado en dicha instalación y que son quienes se beneficiarán en primera instancia de las capacidades del equipo para poder ejercer sus cometidos de manera más precisa y eficiente, pero que permitirá a la vez, dado el carácter de acceso abierto de la ICTS, ofrecer un servicio en general a la comunidad científica, incluyendo los grupos de investigación del propio IMB-CNM, los Centros de investigación del Cluster BNC-b, las universidades y el conjunto de la comunidad científica nacional, europea o internacional, así como a los departamentos de I+D del tejido empresarial que lo requieran.

Mercedes Calderón Aparicio
Gerente del Instituto de Microelectrónica de Barcelona

Ref.OTE 38/22 EQUIPO DE GRABADO SECO PARA NANOESTRUCTURAS Y
CAPAS DELGADAS DE SILICIO Y DERIVADOS DE SILICIO. IMB-CNM

Versión formato del documento: 11.01.22

CSV : GEN-4ae0-b0e6-4ad4-b577-7a9a-f070-b514-a040

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : MERCEDES CALDERON APARICIO | FECHA : 22/04/2022 13:59 | Informa

